Phenom XL G2

质量控制自动化,多功能台式扫描电镜



Phenom 24" HD 全屏幕图像设计

最高放大倍数 200,000x

同类扫描电镜中样品尺寸最大

一次性放置多达 36 个半英寸样品台,自动马达样品台的移动范围最高可达 X=100 mm, Y=100 mm

完全集成EDS,实时能谱分析

完全集成能谱仪 EDS, 分析如同拍照一样简单

高吞吐量的全自动显微平台

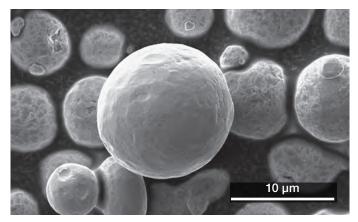
世界上最快的样品加载系统

BSD & SED 混合像

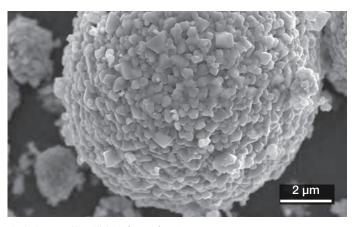
标配 BSD 图像,选配 SED 图像

永不丢失导航

光学导航实现快速准确样品定位与追溯



3D 打印金属颗粒背散射和二次电子混合像



锂电池正极颗粒 扫描电镜 (SEM) 图像

来自飞纳台式扫描电镜的 Phenom XL G2,可自动进行质量控制,并提供准确、可重复的检测结果,让您腾出时间进行其他更有价值的工作。

全新的易于学习的界面可帮助您快速掌握最新信息,是各种应用的理想选择。Phenom XL G2 升级为全面屏成像,平均成像时间仅为 40 秒,比市场上其他台式电镜的速度快 5 倍之多。系统可对最大 100 x 100mm 的样品进行分析,8nm 的分辨率为分析提供更多的细节。专利设计的放气/样品装载系统可以实现全世界最快的放气/装载速度,并获得最大的样品吞吐效率。

一直以来,飞纳台式扫描电镜以"操作简单"这一设计理念引领产品研发,并得到大量客户认可。现在,飞纳电镜更进一步,设备操作变得更加简易:扫描电镜成像与元素分析集成于同一界面,交互式数据栏和全屏图像设计,大大地简化了电镜操作步骤。该界面使得无论是操作过电镜的人员还是未操作过电镜的人员,无需过多培训即可快速上手。

Phenom XL G2 标配四分割背散射电子探头(BSD),提供高品质图像及成分衬度信息。Phenom XL G2 可选配另外两种探测器。第一种是完全集成的能谱仪(即 EDS),可进行元素分析。另外一种是二次电子探测器(SED),可观察样品表面微观细节。此外,还可以选配 ProSuite 应用拓展平台。配备 ProSuite 软件后,可以使用颗粒统计分析测量系统、孔径统计分析测量系统、纤维统计分析测量系统、3D 粗糙度重建系统等软件进一步分析样品。

规格参数

成像模式

光学显微镜 放大倍数: 3 - 19 x电子显微镜 放大倍数: 200,000 x

照明

• 光学 明场和暗场模式

电子光学 · 长寿命、高亮度的 CeB。灯丝

• 多种束流模式

加速电压 • 基本模式: 5 kV, 10 kV 和 15 kV

低-中-高三种模式

高级模式: 4.8 kV 到 20.5 kV 连续可调,用于成像和元素分析

י בלאגט לא ואפוספו ב כו זי קפיי

分辨率 优于 8nm

探测器

真空水平

标配 高灵敏度四分割背散射电子探测器

• 选配 二次电子探测器

图像检测

• 光学 专利设计高分辨彩色光学显微镜导航,一拍即得

电子光学高灵敏度四分割背散射电子探测器(成分和形貌模式)

• 二次电子探测器 (SED) 可选配

图像格式 JPEG, TIFF, PNG

图像分辨率选项 960 x 600, 1920 x 1200, 3840 x 2400

和 7680 x 4800 像素

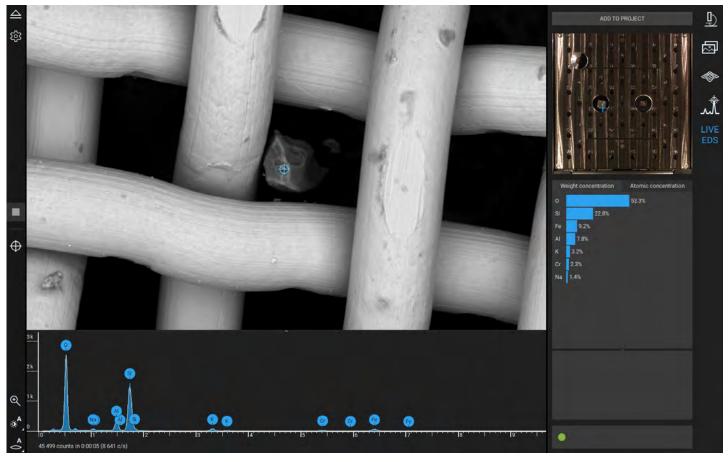
数据存储 ● USB 闪存

• 网络存储

工作站

样品台 电脑控制的全自动马达样品台

抽真空时间 20 s



金属网上颗粒物的 EDS 分析

元素识别软件(EID)

Phenom XL G2 可选配 EDS 探测器,通过 X 射线分析识别元素,从材料中获取更多信息。得益于精确设计的探测器位置,用户无需改变工作距离,即可同时实现高分辨率成像和 EDS 元素分析,操作更加简便快捷。

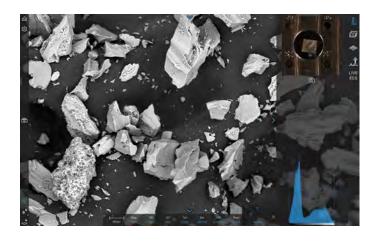
用户可以通过实时 EDS 模式在成像模式下实时识别元素,也可以通过完整能谱软件(EID)进行点分析,选区分析,线扫描和面扫描。

分步数据采集

专门的元素识别软件(EID)用以控制集成在电镜主机内的能谱仪(EDS)。元素分析和成像一样简单,也无需在外部软件或电脑之间来回切换。飞纳电镜采用的 CeB₆ 灯丝可以产生同类扫描电镜中最高的 X 射线计数率,因此可以更快地得到能谱分析结果。

元素识别软件(EID)使用户可以识别元素周期表中几乎所有的元素,从硼(5号元素)到锎(98号元素),这是一款面向大样品或多样品的完美分析工具,项目文件可以存储在本地或者网络上,后续可根据需要再次进行离线分析。

元素识别软件(EID)算法智能,拥有先进的谱峰分析功能、 最优的自动标定功能。同时,在分析过程中用户也可以随时进 行手动标定。软件界面内直观的分布数据采集可以帮助用户以 更加合理、更有组织的工作流程获取所有的能谱分析结果。



软件

- Phenom User Interface
- 集成电子束与样品台控制功能
- 自动识别谱峰
- 迭代反卷积算法
- 分析准确度显示
- 导出功能: CSV, JPG, TIFF, ELID, EMSA

EDS 规格参数

探测器类型

- 硅漂移探测器(SDD)
- 电制冷(无需液氮)
- 探测器有效面积

30 mm²

• X 射线窗口

- 超薄氮化硅 (Si₃N₄) 窗口
- 元素检测范围从硼 (5) 到锎 (98)
- 能量分辨率

Mn K $\alpha \leq 123 \text{ eV}$

• 处理能力

- 2048 通道 @10 eV/ch
- 多通道分析
- 硬件集成

完全嵌入

报告

Docx 格式

系统规格参数

尺寸和重量

• 主机 316(w) x 587(d) x 625(h) mm, 75 kg

▶ 隔膜泵 145(w) x 220(d) x 213(h) mm, 4.5 kg

• 电源 156(w) x 300(d) x 74(h) mm, 3 kg

• 显示器 531.5(w) x 250(d) x 515.4(h) mm, 6.7 kg

工作站

联想 P330,包括: SSD 存储 4 个 USB 插槽

• 92.5(w) x 305.6(d) x 343.5(h) mm, 8 kg

样品尺寸

• 最大 100 mm x 100 mm

(可容纳 36 个直径 12 mm 的样品台)

扫描范围

• 50 mm x 50 mm

• 100 mm x 100 mm (选配)

成像时间

< 40 s

安装要求

环境条件

• 温度 15° C~25° C (59° F~77° F)

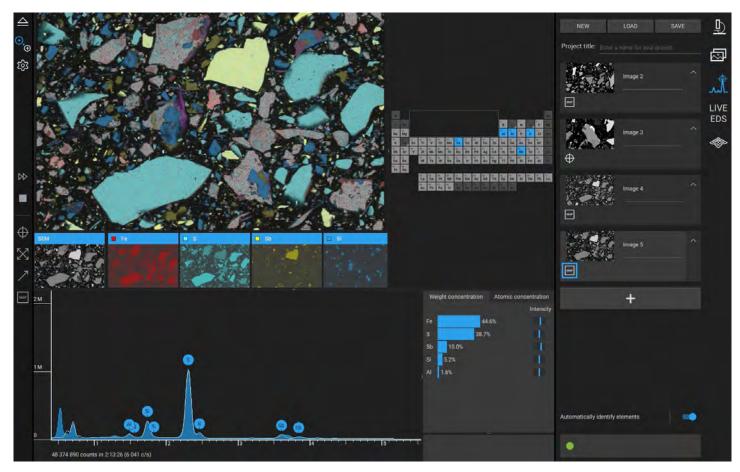
• 湿度 < 60% RH

• 电源 单相交流电 110 - 240 V, 50/60 Hz

352 W (正常运行), 560 W (最大功率)

建议桌台规格 150 x 75 cm, 承重至少 150 kg

规格表 | Phenom XL G2 04



地质样品的 EDS 面扫描分析

自动化

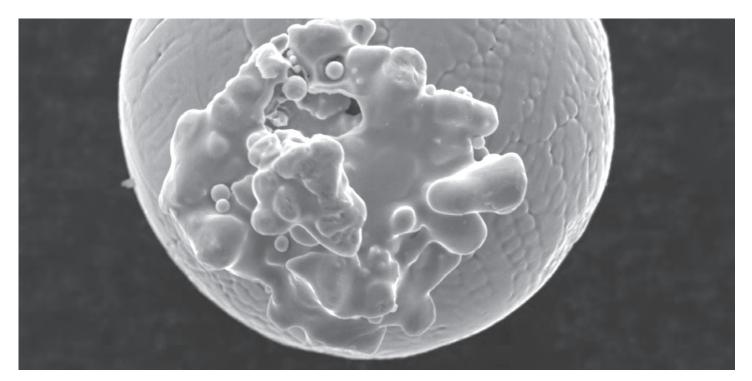
Phenom XL G2 可通过 PPI (Phenom 编程接口)执行自动 化分析程序。如果有重复性的扫描电镜 (SEM)工作流程,如 颗粒分析,孔径分析,纤维分析或拍摄大量 SEM 图像等,可 以通过 PPI 程序让 Phenom XL G2 自动执行此类操作。如果需要,飞纳也可以为您提供定制化软件编程服务。

长寿命 CeB₆ 灯丝

CeB₆(六硼化铈)的长寿命灯丝具有很多优点:与钨灯丝相比,它具有更高的亮度,使用户容易获得具有更多细节的高质量图像;其次,灯丝的寿命长,维护方便。Phenom XL G2 配备的智能软件,可以最大程度地延长灯丝使用寿命:如果不使用机器,灯丝将自动进入休眠状态。Phenom XL G2 运行稳定,即使长时间工作,也可以保持良好的分辨率,提供高质量成像。

优中心倾斜 / 旋转样品杯

在许多扫描电镜(SEM)使用过程中,通过倾斜 / 旋转样品,可以获得更多的材料信息。因此,我们开发了倾斜/旋转样品杯,内置微型马达,以优中心方式工作,通过优中心倾斜、旋转,让您轻松安全地从各个角度观察样品。



3D 打印颗粒成像

元素面扫 & 线扫规格参数

元素面扫

元素选择 可输出用户选定的独立元素和扫描电镜(SEM)成像,

以及元素 / SEM 混合分布像

● 面扫描区域 任意尺寸的矩形区

● 像素停留时间 1 – 500 ms

元素线扫

线扫像素数 16 - 512 pixels像素停留时间 10 - 500 ms

• 线扫描数量 1-100

报告 Docx 格式

二次电子探测器规格参数

探测器类型类型 ET 探测器

优中心倾斜/旋转样品台规格参数

自动倾斜旋转 四个方向: Z(高度), R(旋转), T(倾

斜) 和 X'(X 主轴)

最大样品尺寸 90° 倾斜

直径 < 30 mm; 高度 < 32 mm

< 45° 倾斜

直径 ≤ 37 mm; 高度 ≤ 32 mm

倾斜角度 - 15° 到 + 90°

旋转 360°

欢迎到飞纳电镜以下技术中心参观试用:

• 上海 • 北京 • 广州 • 成都

飞纳电镜中国总部

复纳科学仪器 (上海)有限公司

上海市闵行区申滨路 88 号上海虹桥丽宝广场 T5,705 室

网址: www.phenom-china.com 邮箱: info@phenom-china.com

电话: 400 857 8882



